

課題番号 : F-12-WS-0037
支援課題名 (日本語) : 過酷酸化条件下でのダイヤモンドの表面処理
Program Title (in English) : Surface oxidization treatment of diamonds
利用者名 (日本語) : 新谷 幸弘
Username (in English) : Yukihiro Shintani
所属名 (日本語) : 横河電機
Affiliation (in English) : Yokogawa Electric Corporation

概要 (Summary) :

過酸化条件下でのダイヤモンドの表面処理を考え、高濃度のオゾンガスに基板を暴露させることを検討している。当初、プラズマ・アッシャーの使用を考え、相談したが、オゾン濃度が予想したものより低く、使用することは出来ないことが分かった。

相談の結果、Picosun 社製 ALD 装置が sub% オーダーのオゾンガスを発生するということがわかり、これが可能かどうか実際に調べる。

実験 (Experimental) :

なし

結果と考察 (Results and Discussion) :

なし

その他・特記事項 (Others) :

なし

共同研究者等 (Coauthor) :

なし

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし

関連特許 (Patent) :

なし